

第 50 回真空に関する連合講演会

主催：日本真空協会

期日：平成 21 年 11 月 4 日（水）から 11 月 6 日（金）

場所：学習院創立百周年記念会館 3, 4 階

〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1

講演分野

1. 真空科学・工学：ポンプ、真空計測、真空材料、流れ解析、加速器
真空応用技術、真空プロセス一般
2. 表面工学：コーティング、溶射、腐食防蝕、焼結、浸炭、接合
3. 表面科学：表面物理、表面化学、表面分析
4. 応用表面科学：表面処理、表面改質、実験技術
5. 薄膜：薄膜物性、作成技術、実験技術
6. プラズマ科学：プラズマ計測、プラズマ源、プラズマプロセス、
スパッター製膜、イオン関連術、核融合
7. ナノ構造：ナノ構造、ナノ物性、TEM、SPM、CNT、フラレーン、
クラスター、電子源
8. 電子材料・プロセス：半導体デバイス、電子デバイス、CVD プロセス
エッチングプロセス
9. その他：バイオテクノロジー、トライボロジー、宇宙関連技術他

申込締切：平成 21 年 7 月 21 日（火）

予稿締切：平成 21 年 9 月 13 日（日）

詳細は下記ウェブページをご覧ください。

<http://www.soc.nii.ac.jp/vsj/CONFV/asvsj2009/>

展示会：期間中に併設会において開催します。

懇親会：11 月 5 日（木）に開催します。

問合せ先 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 306 号室 日本真空協会事務局

TEL 03-3431-4395 : FAX 03-3433-5371

e-mail ofc-vs@vacuum-jp.org

<http://www.soc.nii.ac.jp/vsj/>